DIN EN ISO 25178-603:2014-02 (D)

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Oberflächenbeschaffenheit: Flächenhaft - Teil 603: Merkmale von berührungslos messenden Geräten (phasenschiebende interferometrische Mikroskopie) (ISO 25178-603:2013); Deutsche Fassung EN ISO 25178-603:2013

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3

Einleitung ... 4

1 Anwendungsbereich ... 5

2 Begriffe ... 5
2.1 Begriffe, die sich auf alle flächenhaften Verfahren zur Messung der Oberflächenbeschaffenheit beziehen ... 5
2.2 Begriffe, die sich auf x- und y-Abtastsysteme beziehen ... 12
2.3 Begriffe, die sich auf optische Systeme beziehen ... 14
2.4 Begriffe, die sich auf die optischen Eigenschaften des Werkstücks beziehen ... 16
2.5 Spezifische Begriffe zur phasenverschiebenden interferometrischen Mikroskopie ... 17

3 Beschreibung der Einflussgrößen ... 18
3.1 Allgemeines ... 18
3.2 Einflussgrößen ... 19

Anhang A (informativ) Bestandteile eines phasenschiebenden interferometrischen (PSI-) Mikroskops ... 21

Anhang B (informativ) Phasenschiebende interferometrische (PSI-) Mikroskopie — Theorie der Arbeitsweise ... 22

Anhang C (informativ) Messabweichungen und Korrekturen phasenverschiebender interferometrischer (PSI-) Mikroskope ... 27

Anhang D (informativ) Zusammenhänge mit dem GPS-Matrix-Modell ... 30

Literaturhinweise ... 31